

NIMS微細構造解析プラットフォーム装置利用料金表(消費税別)

2021.4.1改定

種別	装置名(型式)	場所	利用形態	課金単位	機器利用(1hあたり)			技術補助(1hあたり)			技術代行1(1hあたり)			技術代行2(1hあたり)			技術代行3(1hあたり)		
					大学・ 公的機関	中小企業	大企業	大学・ 公的機関	中小企業	大企業	大学・ 公的機関	中小企業	大企業	大学・ 公的機関	中小企業	大企業	大学・ 公的機関	中小企業	大企業
TEM千現	実動環境対応物理分析電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-G)	千現	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション (3.5h)	4,000	8,000	12,000	6,100	12,200	18,300	6,310	12,620	18,930	8,200	16,400	24,600	10,300	20,600	30,900
TEM千現	実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-B)	千現	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション (3.5h)	4,000	8,000	12,000	6,100	12,200	18,300	6,310	12,620	18,930	8,200	16,400	24,600	10,300	20,600	30,900
TEM千現	300kV電界放出形透過電子顕微鏡 (Tecnai G2 F30)	千現	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション (3.5h)	3,000	6,000	9,000	5,100	10,200	15,300	5,310	10,620	15,930	7,200	14,400	21,600	9,300	18,600	27,900
TEM千現	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F1, JEM-2100F2)	千現	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション (3.5h)	2,000	4,000	6,000	4,100	8,200	12,300	4,310	8,620	12,930	6,200	12,400	18,600	8,300	16,600	24,900
TEM千現	200kV透過電子顕微鏡 (JEM-2100)	千現	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション (3.5h)	1,000	2,000	3,000	3,100	6,200	9,300	3,310	6,620	9,930	5,200	10,400	15,600	7,300	14,600	21,900
TEM千現	走査電子顕微鏡 (JSM-7000F)	千現	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション (3.5h)	1,000	2,000	3,000	3,100	6,200	9,300	3,310	6,620	9,930	5,200	10,400	15,600	7,300	14,600	21,900
TEM千現	FIB加工装置 (JIB-4000, JEM-9320FIB, JEM- 9310FIB1, JEM-9310FIB2)	千現	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション (3.5h)	1,000	2,000	3,000	3,100	6,200	9,300	3,310	6,620	9,930	5,200	10,400	15,600	7,300	14,600	21,900
TEM千現	デュアルビーム加工観察装置 (NB5000)	千現	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション (3.5h)	3,000	6,000	9,000	5,100	10,200	15,300	5,310	10,620	15,930	7,200	14,400	21,600	9,300	18,600	27,900
TEM千現	ピックアップシステム (Pickup system) *15分単位での利用可	千現	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	時間 (1h)	1,000	2,000	3,000	3,100	6,200	9,300	3,310	6,620	9,930	5,200	10,400	15,600	7,300	14,600	21,900
TEM千現	TEM試料作製装置群 (TEM sample preparation apparatus)	千現	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	時間 (1h)	1,000	2,000	3,000	3,100	6,200	9,300	3,310	6,620	9,930	5,200	10,400	15,600	7,300	14,600	21,900
TEM千現	ウルトラマイクローム (Leica EM UC6)	千現	技術補助・技術代行 共同研究	時間 (1h)	1,000	2,000	3,000	3,100	6,200	9,300	3,310	6,620	9,930	5,200	10,400	15,600	7,300	14,600	21,900
TEM千現	HRTEM解析システム HRTEM Analysis system	千現	技術補助・技術代行 共同研究	時間 (1h)				3,100	6,200	9,300	3,310	6,620	9,930	5,200	10,400	15,600	7,300	14,600	21,900
TEM千現	電子線トモグラフィー解析システム Electron tomography analysis system	千現	技術補助・技術代行 共同研究	時間 (1h)				3,100	6,200	9,300	3,310	6,620	9,930	5,200	10,400	15,600	7,300	14,600	21,900
TEM並木	原子識別電子顕微鏡 (JEM-3100FEF)	並木	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	時間 (1h)	4,000	8,000	12,000	5,500	11,000	16,500	7,000	14,000	21,000						
TEM並木	冷陰極電界放出形ローレンツ電子顕微鏡 (HF-3000L)	並木	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション (3.5h)	2,000	4,000	6,000	4,100	8,200	12,300	4,310	8,620	12,930	6,200	12,400	18,600	8,300	16,600	24,900
TEM並木	冷陰極電界放出形電子顕微鏡 (HF-3000S)	並木	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション (3.5h)	2,000	4,000	6,000	4,100	8,200	12,300	4,310	8,620	12,930	6,200	12,400	18,600	8,300	16,600	24,900
TEM並木	単原子分析電子顕微鏡 (FEI Titan Cubed)	並木	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	セッション (3.5h)	4,000	8,000	12,000	6,100	12,200	18,300	6,310	12,620	18,930	8,200	16,400	24,600	10,300	20,600	30,900
TEM並木	セラミクス試料作製装置群 (Ceramics sample preparation facilities)	並木	技術代行・共同研究	セッション (3.5h)							3,310	6,620	9,930	5,200	10,400	15,600	7,300	14,600	21,900
TEM並木	無損傷電子顕微鏡試料薄片化装置 (NanoMill Model1040)	並木	機器利用・技術補助 技術代行・共同研究	時間 (1h)	1,000	2,000	3,000	2,500	5,000	7,500	4,000	8,000	12,000						

